I₃-光解離過程におけるミクロ溶媒効果

(東大院総合)○加藤修吾,中西隆造,永田 敬

【序】超原子価化合物 I_3 は紫外領域に吸収帯 ($\lambda_{max} \sim 360 \text{ nm}$)を持ち,気相の 355 nm 光解離では、次のような複数の解離チャンネルが観測される[1].

$$I_3^- + hv \rightarrow \Gamma(^1S) + I_2(X^1\Sigma_g^+)$$
 $D_0 = 1.31 \text{ eV}, \Gamma = 0.45$ (1a)
 $\rightarrow I(^2P_{3/2}) + I_2^-(X^2\Sigma_u^+)$ $D_0 = 1.85 \text{ eV}, \Gamma = 0.13$ (1b)
 $\rightarrow \Gamma(^1S) + I(^2P_{3/2}) + I(^2P_{3/2})$ $D_0 = 2.85 \text{ eV}, \Gamma = 0.42$ (1c)

 D_0 は解離のしきいエネルギー, Γ は各解離チャンネルへの分岐比を表す.気相における光解離の特徴は, Γ が主生成物であり,2 体解離チャンネル(I_a)が Γ 生成に大きく寄与する点である.一方,溶液中の光解離では,量子収率 \approx 1 で I_2 が生成する.本研究では,このような気相・液相における I_3 の光解離過程の相違に着目し, I_3 に複数個の溶媒分子を付加したクラスター負イオン I_3 M_n ($M=H_2O$, CH_3OD , CH_3CN)の 355 nm における光解離生成物を調べ,溶媒分子が光解離ダイナミクスに与える影響を解明することを目的とした.

【実験】測定に用いた装置は、クラスター負イオン源と飛行時間型タンデム質量分析計で構成されている. 0.5-1%の CH_3I を含む Ar をキャリアガスとして固体ョウ素を封入したセルを通過させた後、背圧 0.6 atm でパルスバルブから真空中に噴出した.ノズル直下で電子ビームを照射し、 CH_3I の解離性電子付着によって生じる Γ と I_2 の反応によって I_3 を生成した.さらに、溶媒分子 H_2O 、 CH_3OD 、 CH_3CN の気体試料をビーム中に導入し、 I_3 M_n (n=1-7) を生成した.特定の n をもつ I_3 M_n を第一質量分析計で選別し、355 nm のパルスレーザーを照射して光解離させ、フラグメントを第二質量分析計で検出した.

【結果と考察】 I_3 - M_n を 355 nm で光解離すると, Γ - M_k ($0 \le k \le n$)および I_2 - M_l ($0 \le l \le n$)が生成した.各フラグメントの質量スペクトル強度 I から, $\Sigma_k I(\Gamma$ - M_k)と $\Sigma_l I(I_2$ - M_l)を算出し,それらを Γ および I_2 -生成の分岐比 $\Gamma(\Gamma)$, $\Gamma(I_2$ -)とした(但し, $\Gamma(\Gamma)$ + $\Gamma(I_2$ -) $\equiv 1$). $\Gamma(\Gamma)$, $\Gamma(I_2$ -)のサイズ依存性を図 1 に示す.何れの溶媒においても $\Gamma(I_2$ -)は n と共に増加し,ミクロ溶媒和により I_2 -

の生成が促進された. 特に, $M = H_2O$, CH_3OD では, $n = 0 \rightarrow 1$ で分岐比に大きな溶媒和効果が観測され, その後は緩やかな加成性が観測された. また, CH_3CN では $\Gamma(I_2)$ はサイズ n と共により緩やかに増加した.

図3は、スピン軌道相互作用を考慮した高精度CI計 算によって得られた, I₅-光解離に関与するポテンシャ ルエネルギー面(PES)である[1]. 355 nm励起によって I_3 は3体解離 $\Gamma(^1S) + 2I(^2P_{3/2})$ へ相関するポテンシャル 面 $S_3(^3\Pi_u(0_u^+))$ へ遷移する. S_3 はFranck-Condon領域の 近傍でSっと円錐交差を形成する. Sっは断熱的に $\Gamma(^1S)$ + $2I(^{2}P_{3/2}) \geq I(^{2}P_{3/2}) + I_{2}^{-}(X^{2}\Sigma_{u}^{+})$ に相関しており、さらに、 2体解離座標に沿った核間距離の大きな領域で基底 状態 $S_1(^1\Sigma_{\mathfrak{o}}(0_{\mathfrak{o}}^+))$ とcrossing seamを形成する. S_1 は crossing seamの内側では $I(^2P_{3/2}) + I_2^-(X^2\Sigma_n^+)$ に、外側で は $\Gamma(^{1}S) + I_{2}(X^{1}\Sigma_{g}^{+})$ に相関する. したがって, 孤立 I_{3}^{-} のPESに基づいて議論を進めるならば、 $\Gamma(I_2)$ の増加 は、①円錐交差近傍でSっに遷移する確率の増加、②Sっ 面でトラジェクトリーが2体解離に向かう確率の増 加, ③核間距離の短い領域でcrossing seamを経てS₁へ 非断熱遷移する確率の増加が要因となる.

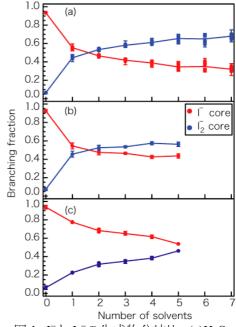


図 1. 「と I₂⁻の生成物分岐比. (a)H₂O, (b)CH₃OD, (c)CH₃CN.

上述のように、 $M = H_2O$ 、 CH_3OD で、1分子の溶媒和によって生成物分岐比に大きな変化が見られたことは、n = 1での溶媒効果が非断熱遷移確率の変化などを伴う、電子的 (electronic) なものであることを示唆している. 今回の結果から、 $\Gamma(I_2)$ の増加の要因を①~③の何れか一つに特定することは困難であり、 $\Gamma(I_2)$ の実測値の大きさから考えると、複数の要因が寄与していると考えられる. 特に、③の要因については、より電荷密度が集中した $\Gamma(^1S)$ + I_2 (X)

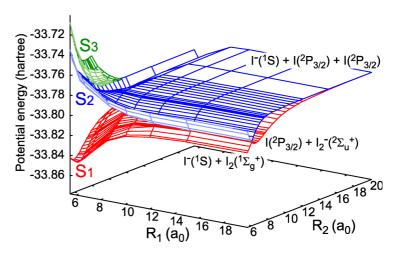


図 2. I₃ 光解離に関与するポテンシャルエネルギー面

 $^{1}\Sigma_{g}^{+}$)に繋がる S_{2} 面が溶媒和によって相対的に安定化し、核間距離の短い領域で S_{1} 面とcrossing seamを形成することにより、解離初期の非断熱相互作用の小さな領域で解離トラジェクトリーが $I(^{2}P_{3/2})+I_{2}^{-}(X^{2}\Sigma_{u}^{+})$ に入り込んだと予想される.

一方, 溶媒和数nの大きな領域では、nの増大につれて $\Gamma(I_2^-)$ が緩やかに増大する傾向について、力学的(kinematic)な"かご効果"の観点から検討する。例えば、 I_2^- M $_l$ に残った溶媒和数lの分布に着目すると、フラグメント質量スペクトルから、 $M=H_2O$ 、 CH_3OD の場合には、 $n \ge 4$ の領域で光解離反応が平均的に

$$I_3 \cdot M_n + h\nu \rightarrow I_2 \cdot M_{n-3} + I + 3M$$
 (2)

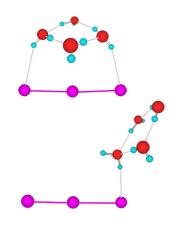


図 3. HF/LanL2DZ レベルの計算で得られた I_3 ·(H_2O) $_4$ の安定構造の例.

ワークの再構築を伴う溶媒分子の動きと I_3 の解離が同時に進行し、統計的なエネルギー分配に従って溶媒蒸発が起こるという、光解離全体の描像を描くことができる。そのような状況では、溶媒和系へのエネルギー散逸による I_3 の内部エネルギーの減少が PES 上の解離トラジェクトリーに大きく影響すると考えられる。孤立 I_3 の Γ , I_2 生成の分岐比は励起波長に強く依存し、励起エネルギーの減少と共に $\Gamma(I_2$)が増加することから[2]、溶媒和数 n の大きな領域で $\Gamma(I_2$)を緩やかに増大させる要因のひとつとして、溶媒系へのエネルギー移動という kinematic なかご効果を考えることができる。

- [1] R. Nakanishi et al., J. Chem. Phys. 126, 204311(2007).
- [2] L. Zhu et al., Chem. Phys. Lett. **350**, 233(2001).